光応用電磁界計測 (PEM) 特別研究専門委員会 第2回研究会開催案内

委員長 水野 麻弥(情報通信研究機構)

本特別研究専門委員会は,急速に進化・変貌を遂げつつある電磁環境を正確に評価・計測するために,電磁界と光・物質との多彩な応答を利用した,新しい電磁界計測技術を追究することを目標としています.計測対象とする電磁界は,アンテナや高周波回路だけでなく,プラズマ電磁界,宇宙到来電磁波など,人工および自然発生電磁界全般を含みます.

第4期・第2回のPEM研究会は,光技術に基づく電界センシング・磁界センシング技術とその雑音計測への応用に関する招待講演ならびに一般講演を予定しております.多数の皆様のご参加をお待ちしております.

日程: 2018年7月26日(木)12時45分~14時00分

場 所: 機械振興会館

〒105-0011 東京都港区芝公園 3-5-8

http://www.jspmi.or.jp/kaigishitsu/access.html

テーマ: 「 光を用いた電界・磁界センシング技術とその雑音計測への応用 」

プログラム:

12:45-13:10 一般講演「アルカリ金属を用いた光学式磁界センサによる交流磁界分布の投影 ~ 信号源位置推定に向けた検討 ~ 」

田上周路(高知工科大)・豊田啓孝(岡山大)

13:10-13:35 一般講演 「光電界センサ/光電圧プローブによるESD評価」

大沢隆二(精工技研)

13:35-14:00 招待講演 「光プローブ高周波磁界計測における変調方式に関する検討」

石山和志 (東北大)

参加費: 無料 資料代: 1,500円

備考:環境電磁工学研究会、機構デバイス研究会、半導体電力変換研究会との併催です。

併せてご参加ください。

問合せ先: 久武 信太郎 (岐阜大学)

Tel: 058-293-2732, E-mail: hisatake@gifu-u.ac.jp

http://www.ieice.org/~pem/